

ЧЕТЫРЕХПОЗИЦИОННАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОК МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО ИСПАРЕНИЯ СО ШЛЮЗОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ



ЭЛУ ТМ 5

Назначение:

Нанесение тонких плёнок на подложки (пластины) методом электронно-лучевого испарения.

Особенности:

- Групповая обработка подложек в одном технологическом цикле:
 - \varnothing 76 мм - 15 шт.;
 - \varnothing 100 мм - 9 шт.;
 - \varnothing 150 мм - 3 шт.;
- Шлюзовая камера для загрузки – выгрузки подложек (Позиция 1);
- Система переноса подложек из шлюзовой камеры в две рабочие позиции (2,3) транспортной каруселью;
- Четырехтигельный электронно-лучевой испаритель;
- Предварительный нагрев подложек и их очистка с помощью источника ионов;
- Безмасляная (сухая) откачка на базе форвакуумного и турбомолекулярного или криогенного насосов;
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления не более 20 кВт;
- Площадь занимаемая одной установкой $\sim 6 \text{ м}^2$.

